



社長あいさつ

今期から3年は「まいた種をきちんと育てる」 期間とします

当社グループを取り巻く環境は、欧州の債務問題を背景 とした景気低迷、緩慢な米国景気の状況や新興国の景気減 速感、日本においては東日本大震災などにより全般的に停 滞感が強く、先行きについても依然として不透明な状況が 続いています。

半導体市場は、一般消費者向けを中心としたパソコン等 の最終製品の需要が減速したことに加え、昨年10月に発生 したタイ国の大洪水が世界的に電子関連産業の生産活動を 阻害したことにより軟調に推移しました。

こうした状況の下、当社グループでは一丸となって売上の拡大を図るとともに、コスト削減に努めたものの、当連結会計年度の業績は、売上高27.424百万円(前期比11.2%減)、うち製品売上高27.114百万円(前期比10.8%減)となりました。また、利益面では、営業利益953百万円(前期比65.7%減)、経常利益1.038百万円(前 期比63.2%減)、当期純利益543百万円(前期比70.2%減)となりました。

当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、東日本大震災の影響等によりラッピング材の売上高は2,960百万円(前期比20.4%減)、ポリシング材の売上高は6,947百万円(前期比8.5%減)となりました。

CMP向け製品につきましては、デバイスメーカーへの 出荷が減少し、売上高は8,029百万円(前期比5.9%減) となりました。

ハードディスク向け製品につきましては、従来型パソコ ンの低調な出荷状況やタイ国の大洪水による影響などから、 売上高は1,788百万円(前期比33.5%減)となりました。

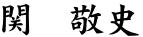
今期の見通しにつきましては、半導体業界で足許復調の 兆しがあり今後の需要回復が見込まれること、また、非半 導体関連の新規需要が見込まれることから、業績面で相応 な回復があるものと想定しています。

中長期経営計画3年目の当期は、新たな成長に向けての 「基礎体力づくり」・「種まき」と位置づけた9年の中長期経 営計画の第一期の最後の年でした。営業と開発の一体化、 品質保証本部の再編、プロダクトサポート室の創設など市 場やお客様のニーズにより迅速かつ的確にお応えできるよ う組織を再編しました。

また、成長のために不可欠な人材育成として人事教育制 度改革プロジェクトを推進し、次の事業の柱の発掘・育成 として新規事業創出プロジェクトに注力した結果、芽が出 つつある用途もあります。

引き続き、当社が理想とする『強く、やさしく、面白い』 会社の実現を目指して、今期から3年は「まいた種をきち んと育てる」期間とし、中長期経営計画のステップである 基盤強化を図ってまいります。

2012年7月 代表取締役社長



プロフィール

フジミインコーポレーテッドは、1950年の創業以来、分級技術などを活かした精密人造研磨材メーカーとして独自の歩みを続けてきました。蓄積されたノウハウと研究開発から生まれた製品の数々は、光学レンズ用研磨材から出発し、シリコンウェハーに代表される半導体基板の鏡面研磨、 半導体チップの多層配線に必要な CMP (化学的機械的平坦化)、コンピュータ用ハードディスクの研磨など高精度な表面加工が求められる先端産業に欠かせぬものとなっています。最近では、耐衝撃性を飛躍的に高めたサーメット溶射材やCO2削減・省エネで注目されているLED用サファイア基板向け研磨材の商品化で新分野を開拓しています。 目次

社長あいさつ	1
当社の経営方針	3
研究開発活動	7
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
貸借対照表*	13
	15
キャッシュ・フロー計算書*	16
会社データ	17
株式情報	18

*連結での数値を記載してあります。

Message from the President

We will commence the second three-year phase of our plan, to "raise the seeds we have planted."

During the year, the global economy was characterized by economic sluggishness in Europe stemming from the debt crisis, slower growth in the United States and deceleration in emerging markets. The Japanese economy also experienced a marked sense of stagnation in the aftermath of the Great East Japan Earthquake. Accordingly, the economic outlook remained difficult to judge.

The semiconductor market was soft, as general consumer demand for final products such as personal computers decreased. Furthermore, flooding in Thailand in October 2011 disrupted production by the world's electronics manufacturers.

In this environment, the Fujimi Group put forth every effort to boost sales and reduce costs. Nevertheless, consolidated net sales fell 11.2% year on year, to ¥27,424 million. Of this amount, product sales accounted for ¥27,114 million, down 10.8%. On the profit front, operating income dropped 65.7%, to ¥953 million; ordinary income decreased 63.2%, to ¥1,038 million; and net income decreased 70.2%, to ¥543 million.

The Company's mainstay business, products for silicon wafers, was affected by the Great East Japan Earthquake, with lapping materials down 20.4%, to ¥2,960 million, and sales of polishing materials down 8.5%, to ¥6,947 million.

Our sales of products for chemical mechanical planarization (CMP) slid 5.9%, to ¥8,029 million, as shipments to device manufacturers declined.

Sales of compounds for hard disks fell 33.5%, to ¥1,788 million, affected by lackluster shipments of conventional personal computers and the effects of the flooding in Thailand.

In the upcoming fiscal year, we expect operating performance to rebound substantially. This anticipation is based on the current state of the semiconductor market, which is beginning to recover, and new demand from non-semiconductor sectors.

The current fiscal year was the third for our nine-year Mid-Long Term Management Plan, marking an end to the first phase, which was positioned as the period for establishing the foundations for growth and

Profile

Since its founding in 1950, Fujimi Incorporated has continued to chart a course as a manufacturer of synthetic precision abrasives. Drawing on its accumulated expertise and extensive research and development (R&D) capabilities, the Company has expanded from abrasives for optical lenses to a variety of products that deliver the ultraprecise planarization sought by leading-edge high-tech industries. Fujimi's lineup covers the complete spectrum from compounds for silicon wafers and other semiconductor substrates, to chemical mechanical planarization (CMP) products required for multilayered circuits on semiconductor chips and compounds for computer hard disks. Recently, the Company is cultivating new fields, commercializing products for cermet (ceramicmetallic composite) thermal spray materials with dramatically improved impact resistance and polishing compounds for sapphire substrates used in LEDs, which are gaining attention for their role in reducing CO2 and conserving energy.



"seeding" our operations. During the year, we integrated our sales and development functions, reorganized our quality assurance department and established a product support office. These restructuring measures were designed to revamp our organization in order to meet customer needs more quickly and precisely.

Recognizing that cultivating human resources is essential to our growth, we launched a human resource educational system reform project. We also concentrated on sowing the seeds of growth with a new business creation project designed to uncover and cultivate businesses that will become future pillars of our operations.

As part of our continued efforts to achieve our corporate vision of becoming a "strong, kind and exciting" company, in the upcoming fiscal year we will commence the second three-year phase of our plan, to "raise the seeds we have planted," and strengthen infrastructure as the next step of our Mid-Long Term Management Plan.

July 2012

Keishi Seki, President

Contents

Message from the President	2
Management Objectives	4
Research and Development Activities	8
Selected Financial Data*	9
Balance Sheets*	13
Statements of Income*	15
Statements of Cash Flows*	16
Corporate Data	17
Stock Information	18

* Indicated figures are on a consolidated basis.

当社の経営方針

はじめに

当社は「パウダーテクノロジー」を事業領域の基本として、コア技術を高め先端技術をリードすることにより、お 客様の満足度を高め信頼を勝ち得てまいりました。「企業使 命」「経営姿勢」および「行動規範」から構成される企業理 念を掲げ、創業以来一貫して製品の高品質化と安定供給に 努めております。

当社が創業以来持ち続ける「ものづくり」の姿勢、お客様に高品質な製品を安定提供するための努力は変わることが

企業理念

企業使命

高度産業社会の期待に新技術で応え、地球に優しく、人々が 快適に暮らせる未来の創造に貢献します。

経営姿勢

- ・お客様の視点に立って独自のソリューションを提案します。
- ・経営環境の変化に対応するため、何事にも積極果敢にチャレンジし、変革し続けます。
- ・技術と経営の質を高め、法令を遵守し、ステークホルダー の信頼に応えます。

行動規範

- ・お客様の満足を追求し、その信頼にお応えします。
- ・問題の本質を追究し、迅速かつ確実に解決します。
- · 夢の実現に向け、熱意 · 誠意 · 創意をもって行動します。
- ・ひとりひとりのアイデアを尊重し、それをカタチにします。
- ・良き市民・良き国際人として高い倫理観をもって行動します。

ありません。ますます多様化するお客様のニーズや技術水準 の高度化に対して、迅速かつ的確に対応し、「顧客満足を高め る質の創造と提供」を目指した体制づくりに取り組むことに より、企業価値を高めてまいります。

また、コーポレートスローガン「技術を磨き、心をつなぐ」 はあらゆるステークホルダーの期待に応え、世界の人々の生 活を豊かにしたいという当社の願いを表すものとして引き続 き掲げてまいります。

企業ビジョン

事業アイデンティティ

パウダー&サーフェイス分野で世界最高技術を提供し、私たち が理想と考える「エクセレントカンパニー」を目指します。

私たちが考える「エクセレントカンパニー」とは、業績が 優れているだけでなく次の3つを実現する会社です。

- ·変化に的確に対応し、未来に向けて持続的に成長する。
- ・企業理念・ビジョンの実現に向け、一人ひとりが熱意をもって、 活き活きと仕事に取り組む。
- ・循環型社会の一員として環境負荷の低減に貢献する。

企業文化ビジョン

強く、やさしく、面白い会社を目指します。

- · 自由闊達で切磋琢磨する風土をつくります。(強く)
- ·仲間を大切にし、助け合い、感謝します。(やさしく)
- ·夢をいだき、夢がかなう職場をつくります。(面白い)

事業構造ビジョン

既存事業の強化を図りつつ新規分野に積極果敢にチャレンジ し、半導体関連分野(シリコン・CMP)と非半導体関連分野 の安定した事業バランスの構築を目指します。

企業理念 Corporate Philosophy

企業使命 Corporate Mission

経営姿勢 Management Policy 行動規範 Code of Conduct

Management Objectives

Introduction

Fujimi has endeavored to earn the trust of and further satisfy its customers by advancing its leading-edge core technologies, centered on its base in powder technologies. In line with our corporate philosophy, which comprises our Corporate Mission, Management Policy and Code of Conduct, we continue in our efforts to consistently deliver a stable supply of high-quality products—a cornerstone of our business.

Since our establishment, we have worked persistently to provide our customers with a stable supply of high-quality

Corporate Philosophy -

Corporate Mission

To develop new technologies to meet the needs of high-tech industries, and contribute to the creation of a bright future that is friendly to the earth.

Management Policy

- We propose original solutions by adopting the viewpoint of the customer.
- To correspond to changes in the business environment, we continue to take on new challenges and make reforms positively.
- We respond to the trust our stakeholders placed in us by improving the quality of our technology and management, and observing the law.

Code of Conduct

- · We seek to satisfy and prove to customers trustworthy.
- We search for the essence of problems and solve them with quickly and with certainty.
- We accept challenge with enthusiasm, honesty and creativity, as we work to achieve our goals.
- · We respect and act on individual ideas.
- We will act as a good corporate citizen and maintain a strong sense of ethics.

products, a manufacturing approach from which we have never wavered. We aim to increase corporate value by swiftly and accurately meeting the diverse needs of customers with sophisticated technologies. To enhance corporate value, we are conducting organizational initiatives designed to create and deliver quality that will satisfy our customers.

To meet all our expectations, our corporate slogan, "polishing our technologies and bringing people together," which expresses our desire to provide the people of the world with a rich lifestyle, will remain the same.

Corporate Vision –

Business Identity

We offer the world's highest level of technology in the powder and surface fields, and aim to be an "excellent company."

Being an "excellent company" means not only having excellent results. It also includes the following.

- Respond to change precisely, and grow continuously.
- Each person works eagerly to achieve the corporate philosophy and vision.
- Contribute to decreasing the environmental impact as a member of a recycling-based society.

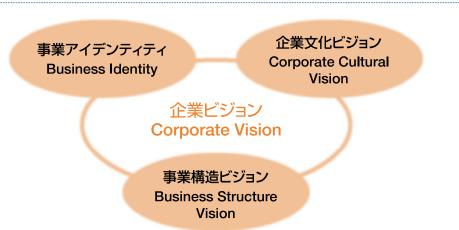
Corporate Cultural Vision

Fujimi will be a strong, kind and exciting company.

- Arrange to work hard with a free and broad mind. (Strong)
- Be nice, cooperative and appreciative to colleagues. (Kind)
- Have a future plan, and form individual working groups to achieve such plan. (Exciting)

Business Structure Vision

Fujimi will strengthen its existing businesses while aggressively taking on challenges in new fields. We will construct a stable business that is balanced between the semiconductor (silicon and CMP) and non-semiconductor fields.



企業ビジョンの構成 Structure of the Corporate Vision

中長期的な会社の経営戦略

当社はバランス・スコアカード(BSC)の考え方を基に、 2009年6月に2018年3月期を最終年度とする中長期経営計 画を策定いたしました。この中長期経営計画は、3年を区切り とする3次の中期計画を基にして、数値的な定量的な計画だけ でなく当社のありたい姿を含めた定性的な計画としています。

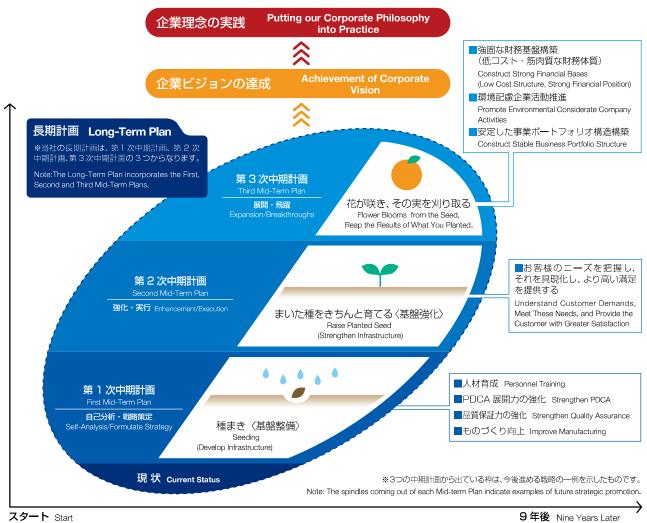
中期計画の第一段階は自己診断と成長のための基礎体力づく り、成長のための種まきにあて、第二段階はまいた種をきちん と育てる時期、そして第三段階は事業開花させ、実を収穫する 時期、とそれぞれ位置づけています。

中長期計画の3年目にあたる当期は、第1次中期計画の「種 まき〈基盤整備〉」の時期に相当し、「人材育成」「ものづくり向上」 「品質保証力の強化」に取り組みました。

今後当社は、経済環境の変化のなかでアグレッシブな成長を 目指し、積極果敢にチャレンジしなければならないと考えてお ります。それに加えてどの様な景気変動下にあっても安定的な 成長を遂げるため、特定の事業や用途に偏ることがない事業構

造が必要と考えております。そのため従来から推進しているシ リコン・CMP・ディスク・機能材・溶射材の5 事業に加え、新 規事業と新たな用途の探索に継続的にチャレンジし、その実現 に向けさまざまな可能性を含めた検討を進めることとしました。 具体的には、(1)ろ過・分級、(2)砥粒、(3)ケミカルの3つの コア技術を中心に、技術開発を進め、商品開発の加速、事業の さらなる拡大を推進しております。また、営業と開発を一体化し、 市場やお客様の二一ズにより迅速かつ的確にお応えできるよう 組織を再編いたしました。このことを通じて安定した事業構造 を維持するため、将来的には事業構造比率として半導体関連比 率50%、非半導体関連比率50%を目指しております。

また、全社レベルの目標を事業ごとに戦略目標、施策とし て具現化し、その成果については評価指標 (KPI) によって四 半期ごとに進捗管理するなど、明確な責任体制のもと事業戦 略を組織横断的に展開しております。





Mid-Long Term Management Strategy

Based on its core concept of a Balanced Scorecard (BSC), Fujimi has formulated a Mid-Long Term Management Plan to guide the Company from June 2009 through the fiscal year ending March 31, 2018. The plan is separated into three parts and is based on three successive mid-term plans. In addition to quantifiable objectives, the plan includes qualitative elements that describe the type of organization Fujimi aims to become.

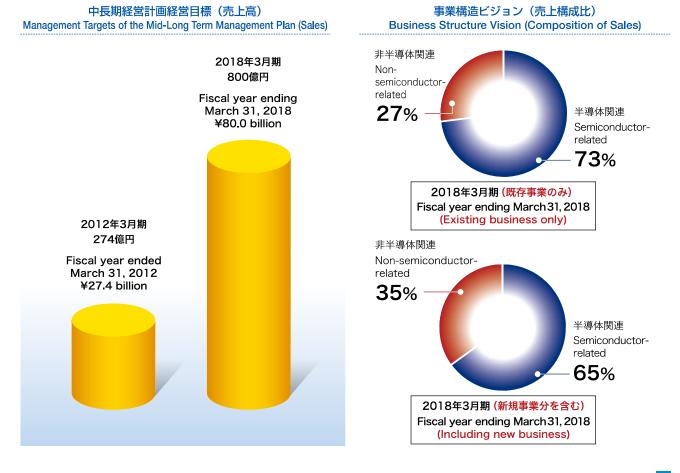
The first stage of our mid-term plan involves self-analysis and establishing the foundations for growth—"seeding" our operations. The second stage involves raising the planted seeds, and at the third stage we plan to reap the results of the seeds of progress we have planted.

This fiscal year was the third year of the first stage, which was the "seeding" phase, and accordingly we have pursued initiatives involving personnel training, improving manufacturing and strengthening quality assurance.

Fujimi understands that achieving its aggressive growth targets in a changing economic environment will require it to take a proactive stance toward upcoming challenges. Furthermore, ensuring stable growth under fluctuating business conditions requires the Company to adjust its business structure along the lines of specific businesses and applications. For this reason, we will continue our search for new businesses and applications in addition to the five areas we have pursued to date (Silicon, CMP, Disk, Specialty materials and Thermal spray materials). We established a specialized section concentrating mainly on three core technologies involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, for promoting technological development, accelerating product development and targeting further business expansion in these areas. Furthermore, we reorganized our business to achieve greater integration between sales and development and enable us to respond more quickly to market demands and the needs of our customers.

Through these efforts, we aim to achieve a business structure in which 50% of our revenues come from semiconductor-related businesses and 50% from non-semiconductorrelated businesses.

On a companywide level, we have established strategic targets for the five businesses, by creating specific measures and defining key performance indicators to monitor progress on a quarterly basis. We are deploying operational strategies across the organization, based on a system of clearly defined responsibilities.



研究開発活動

当社は、超精密研磨のリーディングカンパニーとして、常に先端電子産業を支えるべく、シリコンウェハー、半導体デバイス、ハードディスクをはじめとする、さまざまな電子部品の研磨・研削材の開発に積極的に取り組んでいます。

また、溶射材の開発、当社成長のコアとなる基盤技術開発機能の充実、技術に基づいた新規事業・新規テーマの調査企画機能の強化に努めています。

シリコンウェハー

シリコンウェハー 300mmの 需要拡大、デザインルールの超 微細化に伴い、超精密研磨の要 件である、①平坦化、②無欠陥化、

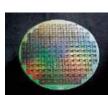


③平滑化、④汚染低減、⑤生産性向上への要求はますます強 くなっています。平坦化と生産性向上が求められている、ラッ ピング材やシリコンウェハー切断用研磨材では、加工精度と 加工歩留まり向上のために、砥粒の細粒化に注力しています。

最終仕上げに用いられるポリシング材では、無欠陥化、平 滑化、汚染低減への要求がますます強くなっています。22nm デバイス世代のウェハー研磨用として、研磨後表面のナノ欠 陥を激減させるポリシング材や、原子レベルの平滑性を実現 するポリシング材の開発を推進しています。また、一次研磨 工程ではウェハー中心部から外周部まで超平坦に加工できる ポリシング材や、生産性向上につながる高速ポリシング材に も、砥粒・添加剤技術を応用しながら開発に取り組んでいます。

デバイス CMP -

先端の半導体デバイスメー カーでは、微細化が進められ技 術ノード22nmのLSIが量産 開始されました。トランジスタ 構造は3Dと呼ばれるように立



体化され、メタルゲート等の新たな材料が使われ始めています。こうした先端デバイスでは、その製造工程において、 従来以上の沢山の CMP プロセスが使われ、多くの用途の ポリシング材が用いられています。

当社では、Cu 配線用のポリシング材のみならず、先端 デバイスに対応するため、アルミニウム、poly-Si(ポリシ リコン薄膜)、SiN(ナイトライド薄膜)、W(タングステ ン薄膜)用のポリシング材の開発を進めています。微細な デバイスでは、ナノオーダーの平坦化、無欠陥化と言った 性能の面だけでなく、品質安定性、コストの面でも従来以 上の改善が強く求められており、当社の砥粒技術、ろ過・ 分級技術、ケミカル技術を活かし、最先端のデバイス製造 に応じた研磨装置や表面検査装置の活用によって、お客様 のご要望にお応えできるよう開発を進めています。

ハードディスク -

今後増大していくデーター必要 量に対応するために、次世代ハー ドディスクの開発が加速していま す。現在、ハードディスク基盤に



求められる欠陥・汚染低減への要求はさらに厳しくなってお り半導体の表面で求められている欠陥・汚染レベルが必要と なってきています。本要求に応えるべく、お客様と一体となった活動を実施し新商品の開 発を推進しています。

機能材 -

新規事業として、LED・ディスプレイ・パワーエレクトロニクス用部品の表面加工分野や、 パウダー技術を活かした応用分野への展開に積極的に取り組んでいます。

環境・エネルギー産業分野では、LED やパワーエレクトロニクス用部品の需要が急増して います。CO2削減や省エネで注目を浴びる LED 用サファイア基板や、次世代パワーエレク トロニクス用として期待されている GaN・SiC 基板は、極めて硬質なために加工に膨大な時 間を要しており、製造コスト削減のために加工速度の向上が切望されています。これら硬脆 材料基板にダメージを与えることなく、高効率な加工を実現する、研磨・研削材の開発を推 進しています。

ディスプレイ産業分野では、ディスプレイの多様な発展を支える各種部品の表面加工材料、 レア・アース代替研磨材の開発などを推進しています。また、角状ナノアルミナなど、パウダー の特徴を活かした機能材料、光学レンズ用の研削材料の開発にも取り組んでいます。

開発企画部門では、当社のコア技術が展開可能な新規分野を、技術と市場の両視点から探索し、新規商品・新規開発テーマの企画を推進しています。

基盤技術・生産技術

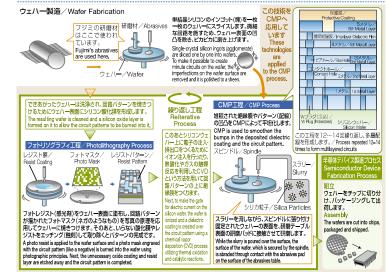
基盤技術・生産技術部門では当社コア技術のさらなる強化に努めています。①ろ過・分級・ 精製、②パウダー、③ケミカルの3つのコア技術を中心に技術開発を進め、商品開発の加速、 高性能化、新規事業分野への展開に貢献しています。

溶射材 -

製造装置・航空機部品用サーメットや電子デバイス・液晶製造 装置用セラミックスなどの高付加価値皮膜用溶射材の開発によ る適用範囲の広がりから、市場規模の拡大が見込まれます。研 究開発としては、近年進展が著しい低温溶射法コールドスプレー、 ウォームスプレー)等の新規溶射法に適した溶射材の開発など に重きを置いて推進しています。



半導体デバイス製造における CMP の役割 Role of CMP Processes in Semiconductor Device Fabrication



Research and Development Activities

As the leading name in synthetic precision abrasives, Fujimi supports the advanced electronic industry through its aggressive development of polishing and abrasive compounds for various electronic components, such as silicon wafers, semiconductor devices and hard disks. Also, we are seeking to enhance the development of thermal spray materials and the fundamental technology development function, which is core to our growth. We are working to strengthen our technology-based new business and topics research and planning function.

Silicon Wafer Compounds -

In accordance with rising demand for 300mm silicon wafers and shrinking design rules, demand is increasing for synthetic precision abrasives that are (1) flat, (2) free from defects and (3) smooth, and that (4) minimize contamination from trace metals and (5) improve manufacturing. We are focused on abrasive grain refinement to improve the processing accuracy and yield rate for lapping and silicon wafer slicing abrasives, which are also required for high-performance flatness and improved manufacturing.

The demand for flat, defect-free, smooth and uncontaminated polishing compounds used in the finishing process are growing stronger. We are developing polishing compounds that will reduce nano defects and achieve the level of smoothness required in polishing next-generation wafers for 22nm devices, as well as polishing compounds that achieve atomic level smoothness. Fujimi is also engaged in the development of abrasives and additive technologies for high-speed polishing compounds, which are linked with productivity increases.

Device CMP -

Semiconductor device manufacturers have commenced mass production of LSIs with increasingly fine 22nm technology nodes. With a physical structure employing 3D transistors, such devices are beginning to employ metal gates and other new materials. The processes used in the manufacture of these leading-edge devices are requiring more CMP processes than ever before, and many of these use polishing compounds.

In addition to polishing compounds for copper wiring, for advanced devices Fujimi has developed compounds for aluminum, as well as polysilicon, silicon nitride and tungsten films. In addition to performance characteristics such as nanometric surface planarity and absence of defects, miniature devices are highlighting the need for stable quality and cost improvements as never before. By leveraging its abrasives, filtration and classification, and chemicals technologies, Fujimi offers the polishing equipment and surface testing devices required to produce leading-edge devices, and we are pursuing development in response to customers' needs.

Compounds for Hard Disks -

The pace of development for next-generation hard disks is accelerating to meet anticipated increases in the volume of data that they will need to handle. Requirements to reduce defects and contamination on hard disk substrates are now approaching the stringent levels demanded for semiconductor surfaces. To meet these requirements, we are working closely with our customers from the new product development stage.

Specialty Materials -

As new areas of business, we are working vigorously to extend our surface-processing techniques to LED, display and power electronics components, as well as to expand the application of our powder technologies.

In environmental and energy-related fields, demand for LED and power electronics components is surging. Sapphire substrates are used in LEDs, which are heralded for their CO₂ reduction and energy saving effects, and gallium nitride (GaN) and silicon carbide (SiC) substrates are slated for use in next-generation power devices. As these substrates are extremely hard, processing requires a great deal of time. Accordingly, we are looking earnestly toward ways to increase processing speeds and thereby lower manufacturing costs. We are developing abrasion and polishing compounds that allow these brittle materials to be processed in a highly efficient manner without damaging them.

For the display industry, we are developing surface processing materials for the various components that support multifaceted display development, as well as abrasives that can be used as alternatives to rare earths.

We are also developing functional materials such as angular nanoalumina, whose particle characteristics lend themselves to use in lens polishing.

In planning its new product and development themes, Fujimi's R&D planning section takes a two-pronged approach to determining development targets, as it looks for fields with development potential for the Company's core technologies, as well as promising new technologies and markets.

Core Technologies, Production Technologies ·

This section focuses on reinforcing Fujimi's strengths in core technologies. By promoting the development of technologies mainly involving (1) filtration and classification, (2) abrasives and (3) chemicals, the section will accelerate product development, target greater functionality and help expand the Company's operations into new fields of business.

Thermal Spray Materials -

We provide cermet materials for manufacturing equipment and aircraft parts, and are also used to form high-value-added coatings on electronic devices and LCD production equipment, which is expected to expand in scale. We are stepping up our development of thermal spray materials in response to robust recent demand for low-temperature sprays (cold sprays and warm sprays) employed in new thermal spray methods.



収益性 Profitability

営業利益/売上高営業利益率

Operating Income and Operating Income Ratio



経常利益/売上高経常利益率

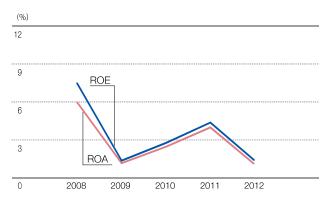
Ordinary Income and Ordinary Income Ratio



当期純利益/売上高当期純利益率 Net Income and Return on Sales

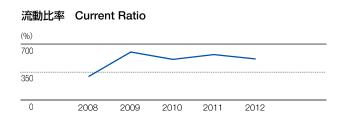


自己資本当期純利益率/総資産利益率 Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA)

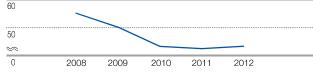


			L					
				平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
		Fiscal years	ended March 31	2008	2009	2010	2011	2012
売上高	(百万円)	Net sales	(Millions of yen)	42,630	34,122	28,177	30,869	27,424
営業利益	(百万円)	Operating income	(Millions of yen)	5,226	1,547	1,496	2,777	953
売上高営業利益率	(%)	Operating income ratio	(%)	12.3	4.5	5.3	9.0	3.5
経常利益	(百万円)	Ordinary income	(Millions of yen)	5,289	1,645	1,699	2,817	1,038
売上高経常利益率	(%)	Ordinary income ratio	(%)	12.4	4.8	6.0	9.1	3.8
当期純利益	(百万円)	Net income	(Millions of yen)	3,249	600	1,161	1,820	543
売上高当期純利益率	(%)	Return on sales	(%)	7.6	1.8	4.1	5.9	2.0
自己資本当期純利益率(ROE)	(%)	Return on equity	(%)	7.5	1.4	2.8	4.4	1.4
総資産利益率(ROA)	(%)	Return on assets	(%)	6.0	1.2	2.5	3.9	1.2

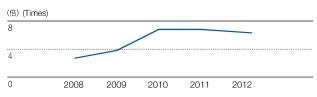
安定性 Stability



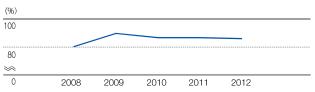
固定比率 Fixed Assets Ratio (%) 60



手元流動性比率 Short Term Liquidity

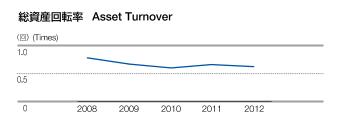


自己資本比率 Equity Ratio

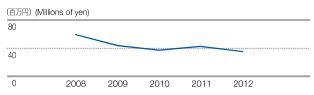


			- L					
				平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
		Fiscal years ended	March 31	2008	2009	2010	2011	2012
流動比率	(%)	Current ratio	(%)	302.8	606.6	513.8	531.9	516.1
固定比率	(%)	Fixed assets ratio	(%)	55.2	50.2	43.3	40.3	41.4
手元流動性比率	(倍)	Short term l iquidity	(Times)	2.8	3.9	6.9	6.9	6.5
自己資本比率	(%)	Equity ratio	(%)	80.3	89.7	86.7	86.7	86.4

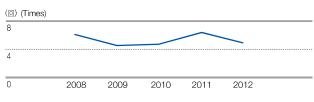
生産性/効率性 Productivity and Efficiency -



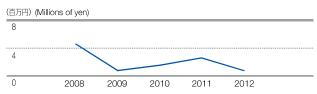
従業員1人当たり売上高 Net Sales per Employee



たな卸資産回転率 Inventory Turnover



従業員1人当たり当期純利益 Net Income per Employee

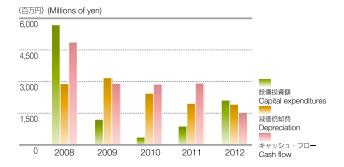


				平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
		Fiscal years	ended March 31	2008	2009	2010	2011	2012
総資産回転率	(□)	Asset turnover	(Times)	0.78	0.67	0.60	0.66	0.62
たな卸資産回転率	(回)	Inventory turnover	(Times)	6.14	4.55	4.73	6.35	4.86
従業員1人当たり売上高	(百万円)	Net sales per employee	(Millions of yen)	59.79	44.00	37.29	41.77	36.08
従業員1人当たり当期純利益	(百万円)	Net income per employee	(Millions of yen)	4.56	0.77	1.53	2.46	0.71
従業員数	(人)	Number of employees		776	775	736	742	760

設備投資/研究開発 Capital Expenditures / Research and Development

設備投資額/減価償却費/キャッシュ・フロー

Capital Expenditures, Depreciation and Cash Flow



研究開発費/対売上高R&D比率

R&D Expenses and Ratio of R&D Expenses to Net Sales



				平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
		Fiscal years e	nded March 31	2008	2009	2010	2011	2012
設備投資額	(百万円)	Capital expenditures	(Millions of yen)	5,694	1,207	363	905	2,116
減価償却費	(百万円)	Depreciation	(Millions of yen)	2,899	3,183	2,448	1,991	1,921
キャッシュ・フロー *1	(百万円)	Cash flow	(Millions of yen)	4,873	2,909	2,880	2,949	1,492
研究開発費	(百万円)	R&D expenses	(Millions of yen)	3,201	2,738	2,025	2,109	2,415
対売上高 R&D 比率	(%)	Ratio of R&D expenses to net sales	(%)	7.51	8.03	7.19	6.83	8.80
	NIZHER WAS							

* 1 キャッシュ・フロー = 当期純利益+減価償却費-配当金

Note: Cash flow = Net income + Depreciation - Dividends

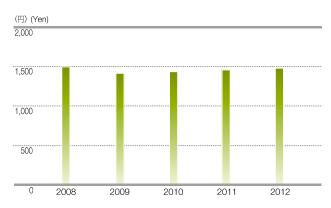
1株当たり配当金/連結配当性向

Cash Dividends per Share, Payout Ratio

投資指標 Per Share Data and Others -



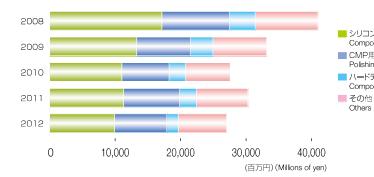
1 株当たり純資産 Book-value per Share (BPS)

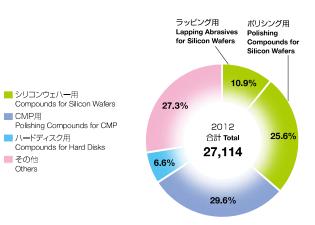


				平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
		Fiscal years ended N	March 31	2008	2009	2010	2011	2012
1 株当たり配当金	(円)	Cash dividends per share	(Yen)	43.00	30.00	30.00	35.00	30.00
連結配当性向	(%)	Payout ratio	(%)	39.2	146.8	75.0	54.8	150.7
l 株当たり当期純利益(EPS)	(円)	Earnings per share	(Yen)	109.64	20.44	39.98	63.82	19.91
1 株当たり純資産(BPS)	(円)	Book-value per share	(Yen)	1,494.76	1,413.55	1,432.59	1,450.83	1,478.56

用途別製品売上高 Sales by Application

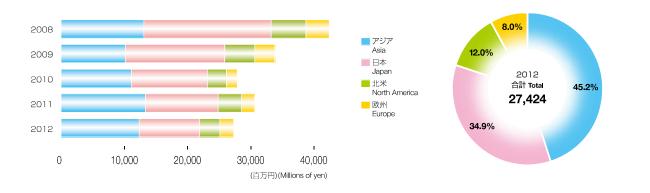
* グラフは商品を含めない自社製品のみの売上高です。 Note: Graph does not include sales of merchandise.





		平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
	Fiscal years ended March 31	3月期	3月期	3月期	3月期	3月期
	(百万円)(Millions of yen)	2008	2009	2010	2011	2012
シリコンウェハ 一 用	Compounds for Silicon Wafers	17,133	13,296	11,037	11,314	9,907
CMP 用	Polishing Compounds for CMP	10,370	8,266	7,262	8,532	8,029
ハードディスク用	Compounds for Hard Disks	4,000	3,469	2,570	2,689	1,788
その他	Others	9,620	8,265	6,854	7,868	7,388

地域別売上高 Sales by Region



	Fiscal years ended March 31	平成20年3月期	平成21年3月期	平成22年3月期	平成23年3月期	平成24年3月期
	(百万円)(Millions of yen)	2008	2009	2010	2011	2012
アジア	Asia	13,169	10,238	11,256	13,469	12,389
日本	Japan	20,247	15,838	12,076	11,579	9,568
北米	North America	5,526	4,843	3,126	3,829	3,282
区欠小川	Europe	3,687	3,202	1,718	1,990	2,183
合計	Total	42,630	34,122	28,177	30,869	27,424

貸借対照表 Balance Sheets

(百万円)(Millions of yen)

			1	l	(日万円)	(Millions of yen)
		平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成24年
	As of March 31	3月期 2008	3月期 2009	3月期 2010	3月期 2011	3月期 2012
 資産の部	Assets	2000	2000	2010	2011	2012
流動資産	Current assets					
現金及び預金	Cash and cash equivalents	6,307	10,095	13,835	12,468	9,490
受取手形及び売掛金	Notes and accounts receivable	12,195	5,912	8,027	6,820	6,504
有価証券	Marketable securities	3,221	103	2,303	5,303	5,301
たな卸資産	Inventories	7,742	7,244	4,676	5,048	6,241
繰延税金資産	Deferred tax assets	640	236	751	632	434
短期貸付金	Short-term loans receivable	303	802	2	3	4
その他の流動資産	Other current assets	351	1,062	130	276	570
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(12)	(197)	(110)	(157)	(41)
流動資産合計	Total current assets	30,747	25,260	29,617	30,396	28,506
固定資産	Fixed assets					
有形固定資産	Tangible fixed assets					
建物及び構築物	Buildings and structures	9,018	8,297	7,568	6,963	6,782
機械装置及び運搬具	Machinery and equipment	5,147	4,496	3,181	2,345	2,062
土地	Land	3,448	3,428	3,400	3,391	3,392
その他の有形固定資産	Other tangible fixed assets	2,842	1,462	1,088	1,218	1,732
有形固定資産合計	Total tangible fixed assets	20,456	17,685	15,239	13,919	13,970
無形固定資産	Intangible fixed assets	425	363	331	305	462
投資その他の資産	Investments and other assets					
投資有価証券	Investment in securities	314	184	253	98	99
長期貸付金	Long-term loans receivable	2	1	1	3	4
繰延税金資産	Deferred tax assets	384	360	82	95	48
その他の投資その他の資産	Other investments and assets	2,910	2,121	1,954	1,925	1,488
貸倒引当金	Allowance for doubtful accounts	(8)	(8)	(16)	(9)	(199)
投資その他の資産合計	Total investments and other assets	3,604	2,659	2,273	2,113	1,442
固定資産合計	Total fixed assets	24,485	20,708	17,844	16,338	15,875
資産合計	Total assets	55,233	45,969	47,462	46,734	44,381

(百万円)(Millions of yen)

		1	1	1		
		平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24年 3月期
	As of March 31	2008	2009	2010	2011	2012
負債の部	Liabilities					'
流動負債	Current liabilities					
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payable	5,185	2,414	3,335	2,905	3,082
短期借入金	Short-term borrowings	720	145	184	81	41
未払法人税等	Corporate tax payable	793	76	476	476	14
賞与引当金	Allowance for bonuses payable	570	368	456	595	612
その他の流動負債	Other current liabilities	2,884	1,159	1,310	1,655	1,773
流動負債合計	Total current liabilities	10,154	4,164	5,763	5,714	5,523
固定負債	Fixed liabilities					
長期借入金	Long-term borrowings	429	250	161	61	_
退職給付引当金	Allowance for employees' retirement benefits	89	85	98	120	147
繰延税金負債	Deferred tax liabilities	13	7	5	8	33
その他	Other fixed liabilities	10	9	5	27	32
固定負債合計	Total fixed liabilities	543	352	271	217	214
負債合計	Total liabilities	10,697	4,517	6,035	5,932	5,737
純資産の部	Net assets					
資本金	Common stock	4,753	4,753	4,753	4,753	4,753
資本剰余金	Capital surplus	5,070	5,070	5,069	5,069	5,069
利益剰余金	Retained earnings	35,344	34,679	35,111	36,069	35,716
自己株式	Treasury stock	(1,349)	(2,104)	(2,764)	(3,792)	(5,711)
株主資本合計	Total shareholders' equity	43,818	42,398	42,170	42,100	39,828
その他の包括利益累計額	Accumulated other comprehensive income	522	(1,162)	(998)	(1,565)	(1,475)
新株予約権	Subscription rights to shares	11	44	63	61	59
少数株主持分	Minority interests	183	172	191	205	231
純資産合計	Total net assets	44,536	41,451	41,426	40,802	38,643
負債純資産合計	Total liabilities and net assets	55,233	45,969	47,462	46,734	44,381

損益計算書 Statements of Income

(百万円) (Millions of yen) 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 Fiscal years ended March 31 2009 2010 2011 2012 2008 経常損益の部 Ordinary income and expenses 営業損益の部 Operating income and expenses 売上高 Net sales 42,630 34,122 28,177 30,869 27,424 Cost of sales 売上原価 29,429 25,178 20.573 21,362 19,399 売上総利益 Gross profit 13,201 8,943 7,604 9,506 8,024 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 7,975 6,107 7,070 7,396 6,729 営業利益 Operating income 5,226 1,547 1,496 2,777 953 営業外損益の部 Non-operating income and expenses 受取利息 Interest income 102 90 50 60 54 受取配当金 Dividend income 2 4 4 2 2 その他の営業外収益 Other nonoperating income 74 87 174 68 72 営業外収益 Non-operating income 183 225 125 136 181 支払利息 Interest expenses 49 47 16 12 5 その他の営業外費用 Other nonoperating expenses 68 37 6 72 46 営業外費用 Non-operating expenses 118 85 22 85 51 経常利益 1,699 1,038 Ordinary income 5,289 1,645 2,817 特別損益の部 Extraordinary items Proceeds from sales of fixed assets 固定資産売却益 1 3 1 3 2 補助金収入 Subsidy income 33 36 _ _ Other extraordinary income その他の特別利益 3 61 18 219 51 特別利益 Extraordinary income 96 58 220 54 6 固定資産除売却損 Loss on disposal of fixed assets 49 54 45 65 15 投資有価証券評価損 Loss on revaluation of investment securities 22 30 ____ _ 減損損失 Impairment loss 284 403 90 その他の特別損失 Other extraordinary losses 54 136 З 19 48 特別損失 Extraordinary losses 388 312 452 107 63 税金等調整前当期純利益 Income before income taxes 1,392 980 4,997 1,467 2,764 法人税、住民税及び事業税 Income taxes-current 1,934 304 546 828 157 法人税等調整額 Income taxes-deferred (224) 448 (255) 97 260 少数株主利益 Minority interest in earnings of consolidated subsidiaries 38 14 17 19 37 当期純利益 Net income 4,080 3,249 600 1,820 543

キャッシュ・フロー計算書 Statements of Cash Flows

						Millions of y
	Final years and a March Of	平成20年 3月期	平成21年 3月期	平成22年 3月期	平成23年 3月期	平成24 ^全 3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー	Fiscal years ended March 31 Cash flows from operating activities	2008	2009	2010	2011	2012
税金等調整前当期純利益	Income before income taxes	4,997	1,392	1,467	2,764	980
減価償却費	Depreciation and amortization	2,899	3,183	2,448	1,991	1,921
減損損失	Impairment loss	2,388	90	403		.,02
固定資産除売却損益(益)	Loss (gain) on sale or disposal of fixed assets	47	50	43	62	12
売上債権増減額(増加)	(Increase) decrease in receivables	538	5,777	(2,081)	1,036	13
仕入債務増減額(減少)	Increase (decrease) in payables	(149)	(2,140)	856	(289)	20
たな卸資産増減額(増加)	(Increase) decrease in inventories	(1,676)	(359)	2,656	(561)	(1,161
その他	Others	(1,070)	(250)	149	110	(1,101
小計	Subtota	6,856	7,743	5,944	5,115	1,99
	Interest and dividends received	104	89	51	68	6
補助金の受取額		23	33	99	00	0,
事業撤退に伴う収入	Income from new industry subsidies	23	33		_	
	Income from withdrawal from business	—		32	_	-
事業撤退による支出	Payments for withdrawal from business	-	(17)	-		-
利息の支払額	Interest paid	(45)	(48)	(16)	(13)	(
法人税等の支払額	Income taxes paid	(2,325)	(1,814)	(135)	(837)	(89
法人税等の還付額 営業活動によるキャッシュ・フロー	Income taxes refunded		_	791	9	-
資活動によるキャッシュ・フロー 定期預金の預入による支出	Cash flows from investing activities Payments for additions to fixed deposits	(500)	_	(1,500)	(1,505)	(2,61
			_		,	
定期預金の払戻による収入	Income from withdrawal of fixed deposits	500	800	150	1,500	2,50
有価証券の増減額(減少)	(Increase) decrease in marketable securities	(99)	—	99	108	(00)
有価証券の取得による支出 有形固定資産取得による支出	Payment for acquisition of securities	(6.046)	(0.000)	(056)	(500)	(800)
有形回足員座取得による文山 その他	Purchase of tangible fixed assets Others	(6,046)	(2,382) 8	(256)	(508)	(1,70
 投資活動によるキャッシュ・フロー	Net cash and cash equivalents used in investing activities	(225) (6,371)	(1,573)	(87) (1,594)	(65)	(26 (2,87
「務活動によるキャッシュ・フロー	Cash flows from financing activities					
短期借入金の純増減額(減少)	Increase (decrease) in short-term borrowings	288	(487)	37	(87)	
長期借入による収入	Proceeds from long-term loans payable	559	(407)		(07)	
長期借入金の返済による支出	Expenses from repayment of long-term borrowings	(1)	(106)	(93)	(87)	(7
自己株式の取得及び 売却による収支	Proceeds from sales of (payments for purchase of) treasury stock	104	(755)	(675)	(1,028)	() (1,91
親会社による配当金の支払額	Payment of dividends by the parent company	(1,273)	(1,265)	(729)	(862)	(97
その他	Others	_	(4)	10	(7)	(11
財務活動によるキャッシュ・フロ ー	Net cash and cash equivalents used in financing activities	(321)	(2,618)	(1,450)	(2,073)	(2,98
見金及び現金同等物に係る換算差額	Effect of exchange rate change on cash and equivalents	23	(624)	17	(171)	(146
見金及び現金同等物の増加(減少)額	Increase (decrease) in cash and cash equivalents	(2,055)	1,169	3,740	1,626	(4,84 1
		44 705	9,729	10,899	14,639	16.06
見金及び現金同等物期首残高	Cash and cash equivalents at beginning of year	11,785	9,729	10,099	14,039	16,26
見金及び現金同等物期首残高 車結子会社の決算期変更に伴う 見金及び現金同等物の増加額	Cash and cash equivalents at beginning of year Increase (decrease) in cash/cash-equivalent transactions due to changes in the accounting period of affiliated	11,785	9,729			15



商号 株式会社フジミインコーポレーテッド Name **FUJIMI INCORPORATED** 設立年月日 1953年(昭和28年)3月20日 Date of establishment March 20, 1953 資本金 ¥4,753,438,500 Paid-in capital 上場市場 東京証券取引所第一部 Securities traded Tokyo Stock Exchange (First Section) 名古屋証券取引所第一部 Nagoya Stock Exchange (First Section) 証券コード 5384 Code 5384

個別

760 (^{個別} Non-Consolidated 588)

従業員数 Number of employees

事務所・拠点 Plants and Offices

本社・枇杷島工場 Headquarters · Biwajima Plant

T 452-8502 愛知県清須市西枇杷島町地領 2-1-1 Phone: 052-503-8181 Fax: 052-503-6166 1-1, Chiryo-2, Nishibiwajima-cho, Kiyosu, Aichi, 452-8502, Japan Phone: +81-52-503-8181 Fax: +81-52-503-6166

稲沢工場 Inazawa Plant

₹ 492-8329 愛知県稲沢市西島町市助河戸 1-1 1-1, Ichisukekoudo, Nishijima-cho, Inazawa, Aichi, 492-8329, Japan

各務原工場 Kakamigahara Plant

504-0927 岐阜県各務原市上戸町 7-1-8 1-8, Jyogo-cho-7, Kakamigahara, Gifu, 504-0927, Japan

各務東町工場 Kakamihigashimachi Plant

T 509-0103 岐阜県各務原市各務東町 5-62-1 62-1, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu, 509-0103, Japan

溶射材事業部 Thermal Spray Materials Department

 $\pm 509-0103$ 岐阜県各務原市各務東町 5-82-28 82-28, Kakamihigashimachi-5, Kakamigahara, Gifu, 509-0103, Japan

研究開発センター R&D Center

〒509-0109 岐阜県各務原市テクノプラザ 1-8 8, Technoplaza-1, Kakamigahara, Gifu, 509-0109, Japan

物流センター Logistics Center 〒 509-0109

岐阜県各務原市テクノプラザ4-1 1, Technoplaza-4, Kakamigahara, Gifu, 509-0109, Japan

東京営業所 Tokyo Office

〒101**-**0047 東京都千代田区内神田 3-2-8 COI 内神田ビル 7F 7th Floor, COI Uchikanda Bldg., 2-8, Uchikanda 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0047, Japan

役員 Board of Directors

2012年(平成24年)6月22日現在 (As of June 22, 2012)

関 敬史 Keishi Seki
伊藤 広 — Hirokazu Ito
土屋太加志 Takashi Tsuchiya
鈴木 彰 Akira Suzuki
大脇 寿樹(新任) Toshiki Owaki
鈴木 勝弘(新任) Katsuhiro Suzuki
石井 和廣 Kazuhiro Ishii
松島 伸男 Nobuo Matsushima
髙橋 正彦 Masahiko Takahashi
川下 政美(新任) Masami Kawashita

台湾事務所 Taiwan Office 新竹縣 302 竹北市縣政九路 215 號 4 樓 4th Floor, No. 215, Shian-Jheng 9th Rd., Jubei City, Hsinchu Hsien 302 Taiwan, ROC

上海事務所 Shanghai Office 上海市浦東区科苑路 88 号、德国中心 317B 室 317B, German Center, 88 Keyuan Road, Pudong Zhangjiang, Hi-Tech Park, 201203, Shanghai, China

韓国事務所 Korea Office RM. 3032, 30th floor, ASEM Tower, 159-1, Samsung-Dong, Gangnam-Gu,Seoul

関連会社 Affiliated Companies -

フジミコーポレーション(米国) **FUJIMI CORPORATION** 11200 SW Leveton Drive, Tualatin, Oregon 97062, U.S.A. Phone: +1-503-682-7822 Fax: +1-503-612-9721

フジミマイクロテクノロジー(マレーシア) FUJIMI-MICRO TECHNOLOGY SDN. BHD. Unit 3, Level 15, Menara Genesis No. 33, Jalan Sultan Ismail 50250, Kuala Lumpur, Malaysia Phone: +60-3-2143-0036 Fax: +60-3-2145-8955

フジミヨーロッパ(ドイツ) FUJIMI EUROPE GmbH Schlossstrasse 5 D-74653 Ingelfingen, Germany Phone: +49-7940-58402 Fax: +49-7940-57611

フジミ台湾(台湾) FUJIMI TAIWAN LIMITED Rm. A02, 1F., No.1, Lixing 1st Rd., East Dist., Hsinchu City 300, Taiwan (R O C) Phone: +886-3-666-3835



大株主一覧 Leading Shareholders

2012年(平成24年)3月31日現在 (As of March 31, 2012)

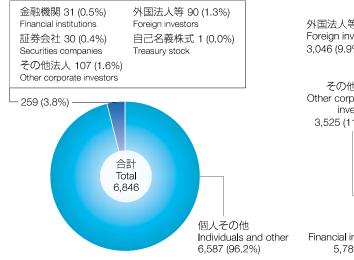
株主名 Name of Shareholder		所有株式数 (千株) Number of Shares Owned (Thousands of Shares)	持株比率 (%) Percentage of Total
株式会社フジミインコーポレーテッド(自己株口)	Fujimi Incorporated (Treasury Stock)	4,760	15.5
越山 勇	Isamu Koshiyama	2,902	9.4
有限会社コマ	Koma Co., Ltd.	1,638	5.3
野田純孝	Sumitaka Noda	1,520	4.9
越山 彰	Akira Koshiyama	1,151	3.7
日本生命保険相互会社	Nippon Life Insurance Co.	779	2.5
株式会社三菱東京 UFJ 銀行	The Bank of Tokyo–Mitsubishi UFJ, Ltd.	728	2.3
ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー サブ アカウント アメリカン クライアント) Northern Trust Co. (AVFC) Sub A/C American Clients	728	2.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	711	2.3
株式会社りそな銀行	Resona Bank, Ltd.	691	2.2
	0 位いてた切り換てしています		

(注)所有株式数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を切り捨てしています。 Note: Shareholdings of less than 1,000 shares are omitted. Percentage shareholding is rounded off after the first decimal place.

所有者別分布状況 Composition of Shareholders by Category

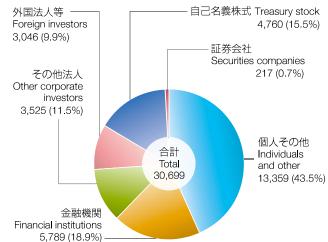
2012年(平成24年)3月31日現在 (As of March 31, 2012)

所有者別株主数(人) Shareholders by Category (Number of Shareholders)



所有者別持株数(千株)

Shares Held by Shareholder Type (Thousands of Shares)



発行済株式の推移 Common Stock Issues

		摘 要 Type of Issue		発行済株式数(千株) Shares Outstanding after Issue (Thousands of Shares)
1992年 (平成4年)2月1日	February 1, 1992	第三者割当増資	Allotment of new shares to third parties	245
1992年 (平成4年)11月20日	November 20, 1992	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split	491
1993年 (平成5年)9月27日	September 27, 1993	新株引受権の権利行使	Exercise of warrants	509
1994年 (平成6年)5月20日	May 20, 1994	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split	1,019
1994年 (平成6年)8月4日	August 4, 1994	500円額面株式1株を50円額面株式 10株に分割	Exchange of 10 stocks with par value ¥50 for 1 stock with par value ¥500	10,195
1995年 (平成7年)4月18日	April 18, 1995	一般公募増資	Public offering of common stock	10,995
1996年 (平成8年)5月20日	May 20, 1996	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split	12,094
1996年 (平成8年)10月1日	October 1, 1996	一般公募増資	Public offering of common stock	12,894
1997年 (平成9年)5月20日	May 20, 1997	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split	14,184
1998年 (平成10年)5月20日	May 20, 1998	1株につき1.1株の株式分割(無償)	1.1-for-1 stock split	15,602
2001年(平成13年)11月22日	November 22, 2001	自己株式の利益消却	Treasury stock purchased and retired	15,349
2005年 (平成17年)5月20日	May 20, 2005	1株につき2株の株式分割(無償)	2-for-1 stock split	30,699





To reduce environmental impact, this publication was printed on environmentally responsible paper made with appropriately managed recycled pulp content of 5% or more, using vegetable ink to reduce emissions of volatile organic compounds (VOCs).

Copyright (C) 2012 Fujimi Incorporated. All rights reserved. Printed in Japan